

國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

儀器使用人員教育訓練與資格檢定申請表

課程名稱	共同儀器中心培訓研習會 - 反應式離子蝕刻機
課程目的	為了讓使用者對本校共同儀器中心之反應式離子蝕刻機有更進一步認識以及提高使用率，特舉辦本培訓研習會。
課程說明	課程分為原理講解課程以及機台維護與操作演示課程，報名者需全程參與。
開放對象	<input checked="" type="checkbox"/> 限本校教職員及學生 <input type="checkbox"/> 限本校教職員 <input type="checkbox"/> 不拘
儀器名稱 (中英文名稱)	反應式離子蝕刻機 Reactive ion etching
儀器簡介	反應式離子蝕刻機是利用射頻電源產生電漿進行蝕刻，此設備為選擇性蝕刻，搭配不同氣體選擇，可以有效達到對不同材料的蝕刻，本儀器有提供 O ₂ 、CF ₄ 。 本儀器可使用 3 吋基板，目前最常蝕刻的基板為 Si、SiO ₂ 、Si ₃ N ₄ 。
儀器照片	

課程時間	103 年 3 月 20 日(四)			
課程地點	進德校區 格致館 4F-會議室			
報名方式	請至線上報名系統報名並下載報名表，以“報名反應式離子蝕刻機教育訓練”為標提名稱，直接寄信至 southsky@livemail.tw 賴高範先生收。信內請註明：姓名、系級、學號、指導教授、實驗室與 200 字內之研究簡介			
報名期限	103 年 3 月 18 日(二)			
招收人數	原理講解與操作演示課程須全程參與，不分梯次，上限 20 人			
收費	500 元，一率現場現金繳費。			
課程表	講題	日期	地點	主講人
	反應式離子蝕刻機原理與系統簡介	3/20 10:30~12:20	格致館 4F 會議室	虎尾科技大學 電子工程學系 吳添全 教授
	反應式離子蝕刻機操作演示	3/20 13:00~17:00	藝薈館 B1 奈米科技中心	
檢定項目發證標準	本儀器採委託操作方式，故不進行檢定及發證			
刊登報名訊息(請勾選)	<input checked="" type="checkbox"/> 本校首頁-最新消息 <input checked="" type="checkbox"/> 科技研究總中心首頁-最新消息 <input checked="" type="checkbox"/> 本校線上報名管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> 共同儀器中心首頁-最新消息			